

522, 934

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004年4月1日 (01.04.2004)

PCT

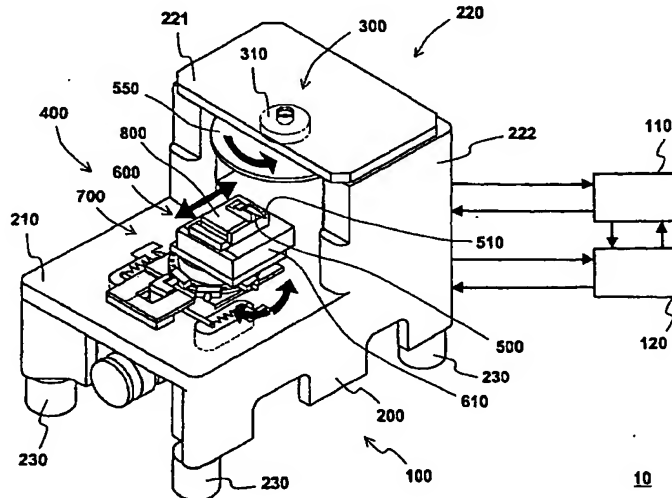
(10) 国際公開番号
WO 2004/027761 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G11B 5/00, 5/455, 5/596, 5/84, 19/20, 21/10, 21/21, H02K 7/08
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/011763
- (22) 国際出願日: 2003年9月16日 (16.09.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-276289 2002年9月20日 (20.09.2002) JP
- (71) 出願人 (日本についてのみ): アジレント・テクノロジー株式会社 (AGILENT TECHNOLOGIES JAPAN,LTD) [JP/JP]; 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (日本, 米国を除く全ての指定国について): アジレント・テクノロジー・インク (AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) [US/US]; 94306-0670 カリフォルニア州 パロ・アルト ページ・ミル・ロード395 CA (US).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三原 隆久 (MIHARA, Takahisa) [JP/JP]; 〒657-0805 兵庫県神戸市灘区青谷町3-2-13 Hyogo (JP). 石本 英司 (ISHI-MOTO, Eiji) [JP/JP]; 〒676-0805 兵庫県高砂市米田町米田685-5 Hyogo (JP). 近藤 高史 (KONDO, Takashi) [JP/JP]; 〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上4-25-1-305 Hyogo (JP).

[続葉有]

(54) Title: SPIN STAND HAVING HYDRODYNAMIC BEARING MOTOR AND HEAD/DISC TEST DEVICE

(54) 発明の名称: 動圧軸受モータを備えるスピンスタンドおよびヘッド/ディスク試験装置



(57) Abstract: A small-size light-weight head/disc test device can be provided at a low cost. A spin stand detachably supports a magnetic head and has a hydrodynamic bearing motor which continues rotation even when the magnetic head is mounted or detached. According to another aspect of the invention, the spin stand has a hydrodynamic bearing motor and means for detecting a change in counter electromotive force or magnetic flux generated by the rotation of the hydrodynamic bearing motor and generating an index signal. According to still another aspect of the present invention, the spin stand has a hydrodynamic bearing motor, conductive fluid is sealed in the bearing of the hydrodynamic bearing motor, and the bearing is grounded. Furthermore, the head/disc test device includes one of the aforementioned spin stands.

(57) 要約: 本発明は、小型軽量化され低価格なヘッド/ディスク試験装置を提供するためになされたものである。本発明のスピンスタンドは、磁気ヘッドを着脱可能に支持するスピンスタンドであって、前記磁気ヘッドの着脱時においても回転を継続する動圧軸受モータを備えることを特徴とするものである。また、本発明のスピンスタンドは、動圧軸受モータと、該動圧軸受モータの回転

[続葉有]

WO 2004/027761 A1



(74) 代理人: 加藤 公久 (KATO, Kimihisa); 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 アジレント・テクノロジー株式会社 法務・知的財産部 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,

AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

により生じる逆起電力の変化または磁束密度の変化を検出しインデックス信号を生成する手段とを備えることを特徴とするものである。さらに、本発明のスピンスタンドは、動圧軸受モータを備えるスピンスタンドであって、前記動圧軸受モータの軸受には導電性流体が封入され、前記軸受が接地されることを特徴とするものである。またさらに、本発明のヘッド/ディスク試験装置は、上記のいずれかのスピンスタンドを備えることを特徴とするものである。

明細書

動圧軸受モータを備えたスピンスタンドおよびヘッド／ディスク試験装置

5 技術分野

本発明は、ヘッド／ディスク試験装置に係り、特に小型軽量で安価なヘッド／ディスク試験装置に関する。

背景技術

- 10 ハードディスクドライブ (Hard Disk Drive ; HDD) の主要部品である磁気ヘッドや磁気ディスクは、ヘッド／ディスク試験装置などにより検査される。なお、磁気ヘッドとは、ヘッド・ジンバル・アセンブリ (Head Gimbals Assembly ; HGA) がその先端部分で支持するヘッドスライダに具備される磁気再生素子と磁気記録素子を総称したものである。以降、磁気ヘッドおよび磁気ディスクは、単にヘッドおよびディスクと
- 15 称する。ヘッド／ディスク試験装置は、HGA、または、複数のHGAを備えるヘッド・スタック・アセンブリ (Head Stack Assembly ; HSA) を被測定対象物とし、ヘッドの特性を試験する装置である。

- ヘッド／ディスク試験装置は、主にスピンスタンドと電気信号測定装置とそれらを制御する制御装置とを備える。スピンスタンドは、ディスク回転装置とヘッド位置決め装置とを備え、高速回転するディスク上にヘッドを位置決めする。このようなスピンスタンドの基本原理については、例えば、特開平6-150269号公報 (図2B)、および、特開2000-187821号公報 (図1, 図12) により開示されている。代表的なスピンスタンドは、Agilent Technologies 社の E5013B、キャノン社の RS-5220U、および、Guzik Technical Enterprises 社の S1701B などである。これらの製品は、ディスク回転装置にエアベアリング・スピンドルモータを、ヘッド位置決め装置にボール
- 20 ネジ、リニアモータ、サーボモータまたはピエゾ素子などの駆動源を用いている。さらに、これらの製品は、エアベアリング等のために空気圧回路を備えている。このようなスピンスタンドの基本構造については、特表2002-518777号公報 (図1)、および、「アジレントテクノロジーズ E5022A/BおよびE5023Aハードディスク・リード／ライト・テストシステム オペレーション・マニュアル 第18版
- 30

(Agilent Technologies E5022A/B and E5023A Hard Disk Read/Write Test System Operation Manual 18th Edition)」, アジレントテクノロジーズ・インク, 2001年6月, p. 17-33、などにより開示されている。

例えば、E5013Bの物理的寸法は、空気圧回路を含む時、幅60cm奥行き78cm高さ102cmである。また、その重さは150kgである。他のスピンスタンドの物理的仕様も、E5013Aとほぼ同程度である。例えば、ヘッドの製造試験は、工場内に多数設置されたヘッド/ディスク試験装置を使用して行われる。従って、ヘッドの製造工場には、ヘッド/ディスク試験装置を設置するための堅牢で広い床が必要とされる。また、スピンスタンド単体だけでも、その価格は数百万円にも及ぶ。記憶容量の増大およびシークタイムの短縮などHDDの性能は向上し続けており、ヘッド/ディスク試験装置に要求される性能も向上し続けている。このため、ヘッド/ディスク試験装置の更新費用も高くなっている。一方、被測定物であるヘッドの市場価格は、極めて安い。従って、ヘッド試験に伴う費用の低減は、ヘッド製造会社にとって極めて重要な課題となっている。

発明の開示

本発明は、上記の課題を解決するために、スピンスタンドおよびヘッド/ディスク試験装置を飛躍的に小型化・軽量化し、低価格化することを目的とするものである。

本発明は、上記の目的を達成するためになされたものであり、以下の通りである。

すなわち、本第一の発明は、スピンスタンドであって、磁気ディスクを回転させるディスク回転手段と、磁気ヘッドを着脱可能に支持し前記磁気ヘッドを少なくとも前記ディスクのトラック幅方向に移動させるヘッド移動手段とを備え、該ヘッド移動手段は、微小可動範囲内で高精度の位置決めが可能な微細位置決め手段と、該微細位置決め手段の微小可動範囲を所定の離散位置に設定する離散位置決め手段とを具備することを特徴とするものである。

また、本第二の発明は、本第一の発明のスピンスタンドにおいて、前記離散位置決め手段が、1つの回転機構を有し、前記磁気ディスク面上と前記磁気ディスク外との間の磁気ヘッドの移動と、前記ディスク面上における前記ヘッドに所定のスキュー角を与えることとを、ともに実現できるようにしたことを特徴とするものである。

さらに、本第三の発明は、本第一の発明または本第二の発明のスピンスタンドにおい

て、前記離散位置が、前記磁気ヘッドを着脱するための、前記磁気ヘッドが前記磁気ディスクから離れた位置を含むことを特徴とするものである。

またさらに、本第四の発明は、本第一の発明乃至本第三の発明のいずれかのスピンス
5 タンドにおいて、前記離散位置決め手段が、駆動手段と、前記駆動手段により駆動され
る可動台を前記離散位置で制動または固定する手段とを備えることを特徴とするもの
である。

また、本第五の発明は、本第一の発明乃至本第三の発明のいずれかのスピンスタン
ドにおいて、前記離散位置決め手段が、駆動手段と、前記駆動手段により駆動される可動
10 台を前記離散位置に導き固定する手段とを備えることを特徴とするものである。

さらに、本第六の発明は、本第一の発明乃至本第五の発明のいずれかのスピンスタン
ドにおいて、前記ディスク回転手段が前記磁気ディスクの一面側にあり、前記位置決め
手段が前記磁気ディスクの他面側にあり、前記磁気ヘッドが前記磁気ディスクの他面側
15 に位置決めされることを特徴とするものである。

またさらに、本第七の発明は、本第六の発明のスピンスタン
ドにおいて、前記磁気ヘッドが前記位置決め手段の真上で支持されることを特徴とするものである。
20

また、本第八の発明は、本第一の発明乃至本第七の発明のいずれかのスピンスタン
ドにおいて、前記微細位置決め手段はピエゾステージを備え、前記磁気ヘッドのギャップ
中心が前記ピエゾステージの中心軸に近接するように、前記磁気ヘッドが前記ピエゾス
テージに支持されることを特徴とするものである。

さらに、本第九の発明は、本第一の発明乃至本第八の発明のいずれかのスピンスタン
ドにおいて、前記微細位置決め手段はピエゾステージを備え、前記ヘッドを含む前記ピ
エゾステージの位置決め対象物の重心が前記ピエゾステージの支持中心点に近接する
25 ように、前記位置決め対象物が前記ピエゾステージに支持されることを特徴とするもの
である。

またさらに、本第十の発明は、本第一の発明乃至本第九の発明のいずれかのスピンス
タン
ドにおいて、前記微細位置決め手段がピエゾステージを備え、トラックを書き込む
30 時における前記ピエゾステージのステージの位置は、該ステージの可動範囲の中心から
オフセットした位置であることを特徴とするものである。

また、本第十一の発明は、磁気ヘッドを着脱可能に支持するスピンスタン
ドであって、
30 前記磁気ヘッドの着脱時においても回転を継続する動圧軸受モータを備えることを特

徴とするものである。

さらに、本第十二の発明は、スピンスタンドであって、動圧軸受モータと、該動圧軸受モータの回転により生じる逆起電力の変化または磁束密度の変化を検出しインデックス信号を生成する手段とを備えることを特徴とするものである。

- 5 またさらに、本第十三の発明は、動圧軸受モータを備えるスピンスタンドであって、前記動圧軸受モータの軸受には導電性流体が封入され、前記軸受が接地されることを特徴とするものである。

また、本第十四の発明は、本第一の発明乃至本第十三の発明のいずれかのスピンスタンドが、防振用ゲルを備えた弦巻バネによって支持されることを特徴とするものである。

- 10 さらに、本第十五の発明は、ヘッド／ディスク試験装置であって、本第一の発明乃至本第十四の発明のいずれかのスピンスタンドを備えることを特徴とするものである。

図面の簡単な説明

- 15 図1 (Fig. 1) は、本発明の実施形態であるヘッド／ディスク試験装置10の斜視図である。

図2 (Fig. 2) は、カセット800の斜視図である。

図3 (Fig. 3) は、ピエゾステージ610とヘッドスライダ510の上面図である。

- 20 図4 (Fig. 4) は、ディスク550上のトラックTとヘッドスライダ510の磁気生素子RDおよび磁気記録素子WRとの位置関係を示す図である。

図5 (Fig. 5) は、ディスク550上のトラックTとヘッドスライダ510およびヘッドスライダ511との位置関係を示す図である。

図6 (Fig. 6) は、ピエゾステージ610とヘッドスライダ510の上面図である。

- 25 図7 (Fig. 7) は、離散位置決め装置700を示す図である。

図8 (Fig. 8) は、離散位置決め装置700の一部を拡大した図である。

図9 (Fig. 9) は、離散位置決め装置700を簡略表示した上面図である。

図10 (Fig. 10) は、離散位置決め装置700を簡略表示した上面図である。

図11 (Fig. 11) は、離散位置決め装置700を簡略表示した上面図である。

- 30 図12 (Fig. 12) は、離散位置決め装置700を簡略表示した上面図である。

図13 (Fig. 13) は、離散位置決め装置700を簡略表示した上面図である。
図14 (Fig. 14) は、離散位置決め装置800を簡略表示した上面図である。
図15 (Fig. 15) は、離散位置決め装置800を簡略表示した上面図である。
図16 (Fig. 16) は、離散位置決め装置800を簡略表示した上面図である。
5 図17 (Fig. 17) は、離散位置決め装置800を簡略表示した上面図である。
図18 (Fig. 18) は、離散位置決め装置800を簡略表示した上面図である。
図19 (Fig. 19) は、スピンスタンド1000の斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

- 10 本発明を、添付の図面に示す実施の形態に基づいて詳細に説明する。本発明の実施形態は、ヘッドおよびディスクの少なくとも一方を試験するヘッド/ディスク試験装置である。図1において、本実施形態のヘッド/ディスク試験装置10は、スピンスタンド100と、電気信号測定装置110と、制御装置120とを備える。電気信号測定装置110は、HGA500と電気的に接続され、HGA500に具備されるヘッド（不図示）の特性を測定する装置である。制御装置120は、スピンスタンド100および電気信号測定装置110の動作を制御する装置である。スピンスタンド100は、ベース200とディスク回転装置300と位置決め装置400とを備える。

- ベース200は、鋳造されたアルミニウム台であって、平面部210とブリッジ部220とを有する。ブリッジ部220は、ディスク回転装置300をぶら下げて支持するスピンドルプレート221と、平面部210から直立しスピンドルプレート221を支えるプレートポスト222とを備える。スピンドルプレート221は、プレートポスト222と着脱可能なようにネジ止めされている。また、ベース200は底面の四隅にベース200を支える足230を有している。足230は、両端に円盤形の金属板を具備する弦巻バネであって、さらに弦巻バネの内側空間に防振用ゲルを備えている。防振用ゲルは、円柱または角柱の形をなす。防振用ゲルの両端は、弦巻バネと同様に円盤形の金属板に接続されている。防振用ゲルは、例えばシリコンゴムやソフトエストラマなどであって、共振周波数の遮断周波数を低くする効果を奏する。その結果、足230は、工場内の機器等からの外来振動を広い周波数範囲で吸収する。防振用ゲルは、耐荷重が小さい。後述の通りスピンスタンド100全体の質量を従来に比べて極めて軽くするので、そのような防振用ゲルをスピンスタンド100に適用できるようになる。

ディスク回転装置 300 は、流体動圧軸受モータ 310 とインデックス信号発生器 I
DX (図示せず) とを備え、ディスク 550 を固定された一方向に回転させる。また、
ディスク回転装置 300 は、ディスク 550 を 4200 rpm、5400 rpm、およ
び、7200 rpm で回転させる事ができる。さらに、これらの中間的な速度も 25 r
5 pm の分解能で実現可能である。なお、これらの回転速度や分解能は例示的に列挙する
ものであって、ディスク回転装置 300 の回転速度や分解能を限定するものではない。
流体動圧軸受モータ 310 は、従来使用していた空気静圧軸受モータに比べて、同一剛
性を実現しながら小型軽量化する事ができる。その結果、モータの体積および重量は約
1/40 になる。なお、ディスク回転装置 300 は、流体動圧軸受モータ 310 を使用
10 するために、一旦ディスク 550 を回転させた後は、その回転を停止しない。従来のヘ
ッド/ディスク試験装置は、ヘッドを交換する毎、すなわち、HGA を交換する毎にデ
ィスクの回転を止めていた。一方、ディスク回転装置 300 は、HGA 500 を着脱す
る場合であっても、ディスク 550 の回転を継続する。HGA 500 の着脱は、HGA
500 の交換はもちろんのこと、HGA 500 の付け直しなども含む。流体動圧軸受モ
15 ータ 310 は、約 10 万回の起動および停止が保証されている。しかし、ヘッド/ディ
スク試験装置 10 は、1 年間に少なくとも 100 万個以上の HGA 500 を検査できる
ことが要求される。例えば、HGA 500 を交換する毎に流体動圧軸受モータ 310 を
起動および停止すると、ヘッド/ディスク試験装置 10 の寿命は 1 ヶ月程度となる。そ
のようなヘッド/ディスク試験装置は、試験装置として不適當である。そこで、ヘッド
20 /ディスク試験装置 10 は、HGA 500 の着脱に関わらずディスク 550 の回転を継
続する。これにより、流体動圧軸受モータ 310 の軸接触が回避され、流体動圧軸受モ
ータ 310 の寿命が長くなる。その結果、流体動圧軸受モータ 310 をディスク回転装
置 300 に適用できるようになった。また、HGA 500 の着脱に関わらずディスク 5
50 の回転を継続するので、流体動圧軸受モータ 310 が所望の回転速度に至るまでに
25 要する時間を気にする必要がなくなる。従って、流体動圧軸受モータ 310 に要求され
る起動トルクを小さく抑える事ができ、流体動圧軸受モータ 310 が小型化される。ま
た、流体動圧軸受モータ 310 の軸受に封入する流体を導電性流体とし、さらに流体動
圧軸受モータ 310 の軸受を接地するので、回転軸を接地するためのグランドコンタク
ト装置が不要になり、ディスク回転装置 300 を小型軽量化する事ができる。グランド
30 コンタクト装置から発生する振動がなくなるので、試験時に発生する機械的ノイズも小

さくなる。

ところで、流体動圧軸受モータ 310 は、従来使用していた空気静圧軸受モータと異なり、その回転軸が片方向にしか突出していない。図 1 において、流体動圧軸受モータ 310 の回転軸（不図示）は下方を向き、その突出部分でディスク 550 を支持している。また、その突出する回転軸の長さは、軸剛性を低下させないように極僅かしかない。従って、従来、インデックス信号を生成するために使用していたロータリーエンコーダは、流体動圧軸受モータ 310 に取り付ける事ができない。ヘッド／ディスク試験装置 10 で用いるインデックス信号は、HDD やフロッピディカルディスクドライブ等のようにモータの回転軸の絶対角度に対応している必要はなく、モータの回転軸の 1 回転（1 周期）を正確に知らせるものであれば良い。そこで、インデックス信号発生器 IDX は、流体動圧軸受モータ 310 の電機子（図示せず）に生じる逆起電力を検出してパルス信号を生成する。さらに、インデックス信号発生器 IDX は、そのパルス信号を分周する事により流体動圧軸受モータ 310 の回転軸の 1 回転毎に 1 パルスが発生するようなインデックス信号を生成する。パルス信号は、流体動圧軸受モータ 310 の電機子（図示せず）に生じる逆起電力信号と流体動圧軸受モータ 310 の電機子（図示せず）のある 1 相の信号とを比較器（不図示）で比較して 2 値化すると得られる。流体動圧軸受モータの制御回路から FG 信号が出力されていれば、その信号をパルス信号の生成に利用しても良い。もちろん、ディスクと共に従来のエンコーダをモータの外部に取り付けることは可能である。しかし、付加的な構成要素を要するので、スピンスタンドの大きさが増す可能性が高い。

位置決め装置 400 は、HGA 500 に具備されるヘッドスライダ 510 を所定の位置へ位置決めする装置である。位置決め装置 400 は、微細位置決め装置 600 と離散位置決め装置 700 とを備える。HGA 500 は、カセット 800 に取り付けられている。カセット 800 は、微細位置決め装置 600 と着脱可能な構造を有する。ここで、カセット 800 の拡大図を図 2 に示す。カセット 800 は、カセットプレート 810 と、HGA 500 を支持するためのマウンティングブロック 820 とを備えている。HGA 500 は、マウンティングブロック 820 に着脱可能に支持される。

図 1 において、微細位置決め装置 600 は、HGA 500 を微小可動範囲内で高精度に位置決めする装置であって、ピエゾステージ 610 を備える。微細位置決め装置 600 は、ディスク 550 の面上においてヘッドスライダ 510 をディスク 550 のトラッ

ク幅方向（ディスク550の放射方向に同じ）、または、ディスク550のトラック幅方向を含む方向に位置決めすることができる。ここで、ピエゾステージ610およびHGA500の上面図を図3に示す。図3において、HGA500に具備されるヘッドスライダ510は、磁気再生素子RDおよび磁気記録素子WRを備える。ピエゾステージ610は、ステージ611と、ピエゾ素子612と、キャパシタンスセンサ613と、バネ614とを備える。ステージ611は、可動台であって、カセット800などの位置決め対象物が連結される。ステージ611は、図示しない支持手段を介してHGA500を支持する。図示しない支持手段には、図2に示したカセット800が含まれる。ステージ611の可動方向は、ピエゾステージ610の位置決め方向である。キャパシタンスセンサ613は、ステージ611の移動量を検知するセンサである。ピエゾ素子612は、印加電圧によって伸長する素子であって、ステージ611を動かす駆動源である。ピエゾ素子612は、キャパシタンスセンサ613により検知される実際の伸長量に基づきフィードバック制御される。

ここで、ディスク400上のトラックと、磁気再生素子RDおよび磁気記録素子WRとの位置関係を、図4に示す。磁気再生素子RDのギャップ中心点Grは、磁気記録素子WRがディスク550上に書き込んだトラックTの中央線Lc上に位置決めされ、さらに、その位置から内周方向および外周方向にそれぞれ2トラック以上移動できる事が要求される。従来のヘッド/ディスク試験装置は、トラックをディスクに書き込む時に、ピエゾステージのステージをステージの可動範囲の中心に位置決めする。この場合、ピエゾステージのステージの可動量は、試験において要求される可動量の2倍以上である必要があった。一方、ヘッド/ディスク試験装置10は、トラックTを書き込む時に、必要とされる可動量及び可動方向に応じて、ピエゾステージ610のステージ611をステージ611の可動範囲の中心位置からオフセットした位置に位置決めする。これにより、ヘッド/ディスク試験装置10は、ステージ611に要求される可動量を必要最小限にしている。その結果、ピエゾ素子612は小型のものが使用でき、微細位置決め装置600は小型化される。

例えば、トラックプロファイル測定は、そのような効果が顕著に現れる測定項目の1つである。トラックプロファイル測定は、ディスク550にヘッドスライダ510の磁気記録素子でトラックを書き込み、その後、書き込んだトラックの磁気強度分布をヘッドスライダ510の磁気再生素子で測定する。ここで、ヘッドスライダ510のリー

ド・ライト・オフセット量を f 、ヘッドスライダ 510 のリード・ライト・セパレーション量を s 、ヘッドスライダ 510 のスキュー角を θ 、トラック・ピッチを p とする。また、磁気強度分布の測定範囲は、内周方向および外周方向にそれぞれ n トラックであるとする。この時、ステージ 611 に要求される可動量 m は、 $m=m1=(f \cdot \cos \theta + s \cdot \sin \theta + n \cdot p / \cos \theta)$ 、または、 $m=m2=(2 \cdot n \cdot p / \cos \theta)$ 、である。なお、 $(f \cdot \cos \theta + s \cdot \sin \theta) > (n \cdot p / \cos \theta)$ である時、 $m=m1$ である。また、 $(f \cdot \cos \theta + s \cdot \sin \theta) \leq (n \cdot p / \cos \theta)$ である時、 $m=m2$ である。上式からも明らかであるが、ギャップ中心点 G_r と磁気記録素子 WR のギャップ中心点 G_w が同じである場合、可動量 m は、 $m=(2 \cdot n \cdot p / \cos \theta)$ である。

ここで、トラックプロファイル測定におけるヘッドスライダ 510 の動きを示した図を図 5 に示す。磁気強度分布の測定範囲は、内周方向および外周方向にそれぞれ 2 トラックであるとする。また、スキュー角 θ は 0° とする。図 5 に示すヘッドスライダ 510 とヘッドスライダ 511 は、互いに鏡像となる構造を有する。ヘッドスライダ 510 およびヘッドスライダ 511 の一方はアップタイプのスライダヘッドであり、他方はダウンタイプのスライダヘッドである。ヘッドスライダ 511 は、ヘッドスライダ 510 と同様に、ピエゾステージ 610 の作用により位置決めされる。ヘッドスライダ 510 は、それぞれ異なる位置 A, B, C に位置決めされている。ヘッドスライダ 510 は、内部に四角形として示される磁気記録素子 WR と円形として示される磁気再生素子 RD とを備える。ヘッドスライダ 511 は、それぞれ異なる位置 D, E, F に位置決めされている。ヘッドスライダ 511 は、同様に内部に四角形として示される磁気記録素子 WR と円形として示される磁気再生素子 RD とを備える。ただし、ヘッドスライダ 511 は、磁気記録素子 WR と磁気再生素子 RD の配置がヘッドスライダ 510 と異なる。ヘッドスライダ 510 およびヘッドスライダ 511 において、磁気記録素子 WR と磁気再生素子 RD との間隔、すなわち、リード・ライト・オフセット量を f とする。また、トラック・ピッチを p とする。ヘッドスライダ 510 は、位置 A において磁気記録素子 WR によりトラック T を書き込む。その後、ヘッドスライダ 510 は、磁気再生素子 RD により位置 B から位置 C までの間を掃引しながらトラック T の磁気強度を測定する。線 $Lc1$ および線 $Lc2$ は、トラック T の中心線 Lc から内周方向および外周方向にそれぞれ 2 トラック ($2 \cdot p$) ずつ離れた位置にある。また、ヘッドスライダ 511 は、

位置Dにおいて磁気記録素子WRによりトラックTを書き込む。その後、ヘッドスライダ511は、磁気再生素子RDにより位置Eから位置Fまでの間を掃引しながらトラックTの磁気強度を測定する。従って、従来のようにトラックTを書き込む時に、ステージ611をステージ611の可動範囲の中心に位置決めすると、ステージ611の可動範囲Mは2m以上が必要である。しかし、上述のようにトラックTを書き込む時にステージ611をステージ611の可動範囲の中心位置からオフセットした位置に位置決めすれば、ステージ611の可動範囲Mはmあれば良いようになる。

ところで、ステージ611は、 piezo素子612に駆動される時、その姿勢が傾き、かつ、斜めの方向へ移動する。そのため、位置決め誤差が生じる。その位置決め誤差は、HGA500とpiezoステージ610とが離れているほど大きくなる。ここで、piezoステージ610の位置決め誤差について説明するために図6を参照する。図6は、piezoステージ610により理想的な方向へ Δ だけ移動した時のHGA500およびヘッドスライダ510と、piezoステージ610により斜めに Δ だけ移動したヘッドスライダ510s（破線で図示）を示す図である。図6において、ステージ611は、図示しない支持手段を介してHGA500を支持する。図示しない支持手段には、図2に示したカセット800が含まれる。図6において、ヘッドスライダ510sは、その姿勢がヘッドスライダ510に比べて傾いている。点Grは、ヘッドスライダ510のギャップ中心である。点Gr sは、ヘッドスライダ510sのギャップ中心である。点Cは、ステージ611の支持中心点である。なお、点Grおよび点Gr sは、ヘッドのギャップ中心点、すなわち、ヘッドスライダ510の磁気記憶素子のギャップ中心点、または、ヘッドスライダ510の磁気記録素子のギャップ中心点のいずれかである。点Grおよび点Gr sがいずれのギャップ中心点であるかは、試験仕様によって定められる。また、支持中心点とは、理想的な移動方向の力をステージ611に加えた場合に、そのステージ611が偏向を生じず理想的な方向へ移動できるような点である。直線 α は、点Cを通り、piezoステージ610の理想的な位置決め方向に伸びる直線である。直線 α は、piezoステージ610の中心軸とも称される。直線 α sは、点Cを通り、piezoステージ610の実際の位置決め方向に伸びる直線である。直線 α は、ギャップ中心点Grを通るギャップ中心線 γ に直交する。直線 α sは、ギャップ中心点Gr sを通るギャップ中心線 γ sに直交する。この時、piezoステージ610の位置決め誤差 ε は、 $\varepsilon = [(L + \Delta) \cdot (1 - \cos \phi) + d \cdot \sin \phi]$ 、として得られる。なお、 ϕ は、直線 α に対

する直線 α s の偏角である。L は、支持中心点C とギャップ中心線 γ との距離である。L は、支持中心点C とギャップ中心線 γ s との距離でもある。d は、ギャップ中心点G r と直線 α との距離である。d は、ギャップ中心点G r s と直線 α s との距離でもある。 Δ は、ステージの移動距離である。偏角 ϕ および移動量 Δ は微小であるので、位置決め誤差 ε は、 $\varepsilon = (d \cdot \sin \phi)$ 、として近似される。従って、ピエゾステージ610
5 の位置決め誤差を低減するためには、d を小さくすればよい。

また、HGA500 は、通常、図3や図6に示すように、ピエゾステージ610 から離れた位置で支持される。そのため、ピエゾステージ610 には、位置決め方向とは異なる方向の力が加わる場合がある。そして、ピエゾ素子612 のフィードバック制御系
10 に不要振動が生じる可能性がある。この不要振動は、微細位置決め装置600 の位置決め精度に悪影響を及ぼす要因となる。従って、ピエゾステージ610 の位置決め対象物は、その重心がピエゾステージ610 の支持中心点にできるだけ近接していることが望ましい。

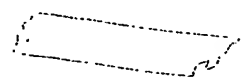
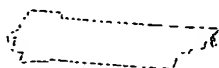
そこで、本実施形態のスピンスタンド100 は、HGA500 をピエゾステージ61
15 0 にできるだけ近接させて支持している。さらに詳しく言えば、スピンスタンド100 は、距離d を小さくするために、ヘッドスライダ510 のギャップ中心点G r がピエゾステージ610 の中心軸（直線 α ）に近接するようにHGA500 を支持している。また、スピンスタンド100 は、不要振動を小さくするために、HGA500 を備えたカセット800 の重心が点C に近接するようにHGA500 を支持している。

また、従来のスピンスタンドには、回転するディスクに対して、両面方向からアクセスできるものがある。この様なスピンスタンドは2つのHGAを1つの位置決め装置で位置決めしている。この場合、位置決め装置はディスク縁端よりも外側に位置し、HGAは位置決め装置から離れた位置で支持されている。位置決め装置とHGAとの距離が長いと、ヘッドの位置決め誤差が生じ易い。一方、図1において、スピンスタンド10
20 0 は、1つのHGA500 を回転するディスク550 の下面に位置決めするようにし、HGA500 を微細位置決め装置600 の真上で支持しているので、その位置決め性能が高い。

さて、図1に示す離散位置決め装置700 は、微細位置決め装置600 を予め決められた離散的な位置に位置決めする装置である。これにより、離散位置決め装置700 は、
30 ヘッドスライダ510 にディスク550 の面上とディスク550 外との間の移動を可

能にさせ、また、ディスク 550 面上におけるヘッドスライダ 510 に試験仕様で定められたスキュー角 θ を与えることができる。ここで、離散位置決め装置 700 のみを図 7 に示す。また、離散位置決め装置 700 の一部を拡大した図を図 8 に示す。以下、離散位置決め装置 700 に関する説明は、図 7 および図 8 を参照する。離散位置決め装置 700 は、予め決められた角度に位置決めする回転位置決め装置である。本実施形態において、離散位置決め装置 700 は、予め決められた 3 つの角度に位置決めすることにより、微細位置決め装置 600 を予め決められた 3 つの位置に位置決めする。予め決められた 3 つの位置とは、HGA 500 を交換するために HGA 500 がディスク 550 から離れているような位置、ヘッドスライダ 510 がディスク 550 面上の内周部付近にあるような位置、および、ヘッドスライダ 510 がディスク 550 面上の外周部付近にあるような位置である。なお、これらの位置は、試験仕様により定められ、上記に限定されるわけではない。離散位置決め装置 700 は、略円筒形の位置決めピン固定ブロック 710 と、位置決めピン固定ブロック 710 を回転させる DC モータ 720 と、位置決めピン固定ブロック 710 に固定されて水平方向に突出する位置決めピン 730 と、逆 L 字形の位置決めブロック 740 と、位置決めブロック 740 を水平移動させる電磁ソレノイド式のアクチュエータ 750 とを備える。

位置決めピン固定ブロック 710 は、複数の歯車 760 を介して DC モータ 720 に回転駆動され、その回転数は 10 rpm 程度である。なお、位置決めピン固定ブロック 710 は、微細位置決め装置 600 を支持する可動台であって、時計回りにも反時計回りにも回転する。位置決めブロック 740 は、リンク 770 を介してアクチュエータ 750 と結合されている。リンク 770 は、リンクシャフト 771 によって支持され、リンクシャフト 771 を中心にして回転する。また、位置決めブロック 740 は、バネ 772 の力で位置決めピン固定ブロック 710 方向に引っ張られている。従って、位置決めブロック 740 は、通常、バネ 772 の力によって位置決めピン固定ブロック 710 方向に引き寄せられている。また、アクチュエータ 750 がリンク 770 を押すと、位置決めブロック 740 は位置決めピン固定ブロック 710 から離れる。位置決めピン 730 は、位置決めピン固定ブロック 710 にネジ止めされている。位置決めピン固定ブロック 710 には位置決めピン 730 の固定位置を精密に変えられるように多くのネジ穴 711 が設けられている。位置決めピン 730 は円柱形のピンであって、その先端部は半球形である。

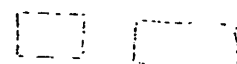


離散位置決め装置 700 は、位置決めピン固定ブロック 710 の回転位置を制御するために、位置決めピン固定ブロック 710 に固定されるセンサプレート 781 と、フォトセンサ 782 とを備える。フォトセンサ 782 は、光透過型のフォトインタラプタであって、発光部と受光部との間を遮光する物体が存在するか否かを検知するセンサである。センサプレート 781 は、遮光板であって、位置決めピン 730 と位置決めブロック 740 が対向する時に、フォトセンサ 782 の発光部と受光部との間を遮光するように位置決めピン固定ブロック 710 に固定される。この遮光状態は、位置決めピン固定ブロック 710 と共に回転するセンサプレート 781 の位置に応じて、有効になったり無効になったりする。

- 10 離散位置決め装置 700 の位置決めは次の様に行われる。図 9 から図 13 は、離散位置決め装置 700 を簡略表示した上面図であって、その位置決め動作を示した図である。以下の説明は、図 7 および図 8 を併せて参照する。図 9 は、磁気再生素子または磁気記録素子がディスク 550 の内周部に位置決めされている時の離散位置決め装置 700 を示した図である。図 9 から図 13 において、針 D（時計の針状のもの）は磁気再生素子または磁気記録素子の位置決め方向を示している。また、針 D の先端部分が磁気再生素子または磁気記録素子のギャップ中心の位置を表す。位置決めピン 730 は位置決めブロック 740 の壁面に接触して静止している。この時、フォトセンサ 782 はセンサプレート 781 により遮光されている。磁気再生素子または磁気記録素子がディスク 550 の内周部から外周部に位置決めされる時、まず、位置決めブロック 740 は、アクチュエータ 750 で駆動されて位置決めピン固定ブロック 710 から離れ、位置決めピン 730 を解放する（図 10）。次に、位置決めブロック 740 を位置決めピン固定ブロック 710 から離れたまま DC モータ 720 を作動させると、位置決めピン固定ブロック 710 は回転移動する（図 11）。すると、フォトセンサ 782 の遮光状態は解除される。この時、位置決めピン 730 は、位置決めブロック 740 の正面からずれた位置にある。ここで、アクチュエータ 750 の駆動を止めると、位置決めブロック 740 は位置決めピン固定ブロック 710 へ接近する（図 12）。さらに、位置決めピン固定ブロック 710 を回転移動させると、位置決めピン 730 は位置決めブロック 740 の壁面に衝突し制動される（図 13）。位置決めピン 730 が位置決めブロック 740 に衝突している時、フォトセンサ 782 は遮光状態にある。ここで、センサに応答して DC モータ 720 を停止する。この時、位置決めピン 730 は、DC モータ 720 の慣性

により暫くの間、位置決めブロック 740 へ衝突し続ける。ここで、電磁力や楔などにより、位置決めピン固定ブロック 710 の位置を固定する。離散位置決め装置 700 は、位置決めピン 730 や位置決めブロック 740 の剛性を十分に高くすれば、高価な高精度の駆動手段やセンサ手段を用いる事なく、それらと同等の高精度な位置決め性能を実現する事ができる。また、位置決めピン 730 を制動するための位置決めブロック 740 は、水平方向に移動する逆 L 字形ブロックに代えて、他の手段も使用することができる。例えば、図 1 において、ベース 200 の平面部 210 より然るべき時に出入りする角柱や円柱などであっても良い。

なお、位置決めピン 730 は離散的な位置に固定されれば良いので、位置決めブロック 740 は位置決めピン 730 を挟むように固定する形状でも良い。例えば、離散位置決め装置 800 は、位置決めブロック 740 に代えて、V 字形溝 791 を有する位置決めブロック 790 を用いることができる。位置決めブロック 790 を用いた離散位置決め装置 800 の位置決めは、次の様に行われる。図 14 から図 18 は、離散位置決め装置 800 を簡略表示した上面図であって、その位置決め動作を示した図である。以下の説明は、図 1、図 7 および図 8 を併せて参照する。図 14 は、磁気再生素子または磁気記録素子がディスク 550 外に位置決めされている時の離散位置決め装置 800 を示した図である。図 14 から図 18 において、針 D（時計の針状のもの）は磁気再生素子または磁気記録素子の位置決め方向を示している。また、針 D の先端部分が磁気再生素子または磁気記録素子のギャップ中心の位置を表す。位置決めブロック 790 は、位置決めピン 730 の先端を押しつけるようにして位置決めピン 730 を固定している。この時、フォトセンサ 782 はセンサプレート 781 により遮光されている。磁気再生素子または磁気記録素子がディスク 550 外からディスクの外周部に位置決めされる時、まず、位置決めブロック 790 は、アクチュエータ 750 で駆動されて位置決めピン固定ブロック 710 から離れ、位置決めピン 730 を解放する（図 15）。次に、位置決めブロック 790 を位置決めピン固定ブロック 710 から離れたまま DC モータ 720 を作動させると、位置決めピン固定ブロック 710 は回転移動する（図 16）。すると、フォトセンサ 782 の遮光状態は解除される。この時、位置決めピン 730 は、位置決めブロック 790 の正面からずれた位置にある。再び、フォトセンサ 782 が遮光状態になった時、次の位置決めピン 730 が位置決めブロック 790 のほぼ正面に位置している。ここで、DC モータ 720 を停止して位置決めピン固定ブロック 710 の回



転移動を止める。さらに、アクチュエータ 750 の駆動を止めると、位置決めブロック 790 は位置決めピン固定ブロック 710 へ接近する (図 17)。離散位置決め装置 800 は、ロータリーエンコーダなど高精度な回転位置検出手段を用いていないので、位置決めピン 730 の位置は位置決めブロック 790 の真正面にあるとは限らない。位置
5 決めブロック 790 の真正面からずれた位置にある位置決めピン 730 の先端は、位置決めピン固定ブロック 710 へ接近する位置決めブロック 790 の V 字形溝 791 の斜面に導かれて、V 字形溝 791 の中心に位置決めされ固定される (図 18)。ここで、さらに電磁力や楔などにより、位置決めピン固定ブロック 710 の位置を固定する。前述同様に離散位置決め装置 800 は、位置決めピン 730 や位置決めブロック 790 の
10 剛性を十分に高くすれば、高価な高精度の駆動手段やセンサ手段を用いる事なく、それらと同等の高精度な位置決め性能を実現する事ができる。

ヘッドスライダ 510 の試験において、スピンスタンドで位置決めしたヘッドスライダ 510 のスキュー角 θ は、一般に、そのヘッドスライダ 510 が実際の HDD 内で位置決めされた時のスキュー角と実質的に同じでなければならない。そのために、スピ
15 スタンド 100 は、ディスク回転装置 300 の回転軸心と離散位置決め装置 700 の回転軸心との間の距離、および、離散位置決め装置 700 の回転軸心と HGA 500 のヘッドスライダ 510 との間の距離を、試験対象であるヘッドスライダ 510 が実際の HDD 内に取り付けられた時のそれらの距離と同じにする必要がある。正確に言えば、離散位置決め装置 700 の回転軸心と HGA 500 のヘッドスライダ 510 との間の距
20 離は、離散位置決め装置 700 の回転軸心とヘッドスライダ 510 の磁気記録素子のギャップ中心点との間の距離、または、離散位置決め装置 700 の回転軸心とヘッドスライダ 510 の磁気再生素子のギャップ中心点との間の距離である。従来のスピンスタンドは、これら 2 つの距離をリニアモータなどにより駆動される位置決め手段を用いて位置決めする事により、随時、様々な仕様のヘッドに柔軟に対応する事ができる。量産試
25 験されるヘッドは、その種類が頻繁に変わらないので、上記の様に随時位置決めする必要はない。その代わりに、スピンドルプレート 221 は、プレートポスト 222 への固定位置が変更可能である。また、微細位置決め装置 600 は、離散位置決め装置 800 への固定位置が変更可能である。さらに、マウンティングブロック 820 は、カセットプレート 810 への固定位置が変更可能である。またさらに、カセット 800 は、微細
30 位置決め装置 600 への固定位置が変更可能である。試験者は、これらの変更の全てを

行うことができる。スピンドルプレート 221 の固定位置の変更により、ディスク回転装置 300 の回転軸心と離散位置決め装置 700 の回転軸心との間の距離を実際の HDD 内での距離と同じにする事ができる。また、微細位置決め装置 600 およびカセット 800 およびマウンティングブロック 820 の固定位置の変更により、離散位置決め装置 700 の回転軸心と HGA 500 のヘッドスライダ 510 との間の距離を実際の HDD 内での距離と同じにする事ができる。

ところで、ヘッドスライダは、アップタイプとダウンタイプの 2 種類がある。アップタイプのヘッドスライダ、または、そのヘッドスライダを備える HGA は、アップ・ヘッドと称される。ダウンタイプのヘッドスライダ、または、そのヘッドスライダを備える HGA は、ダウン・ヘッドと称される。アップ・ヘッドは回転するディスクの下面にアクセスするものであり、ダウン・ヘッドは回転する同ディスクの上面にアクセスするものである。従来のスピンスタンドは、アップ・ヘッドおよびダウン・ヘッドを 1 台のスピンスタンドで試験する構造を有する。例えば、あるスピンスタンドは、ディスクの上面と下面の両方にアクセスできるようなデュアルアーム構造を有する。他のあるスピンスタンドは、ディスクを正逆両方向に回転させることができ、さらに、ヘッドスライダまたは HGA をディスクの上下両面にアクセスさせることができる。本実施形態のスピンスタンド 100 は、ディスクの回転方向と HGA がアクセスするディスク面がそれぞれ 1 つに固定されている。従って、アップ・ヘッドとダウン・ヘッドの両方を試験するために、アップ・ヘッドとダウン・ヘッドのそれぞれに特化したスピンスタンドを使用する。ここで、図 1 と図 19 を参照する。図 19 において、スピンスタンド 1000 は、スピンスタンド 100 と同一の構成要素と有し、それらの構成要素はスピンスタンド 100 と鏡像になるように配置される。図 1 と図 19 において、同一の構成要素は、それぞれの参照番号の下 3 桁が同じである。図 1 において、スピンスタンド 100 は、ディスク 550 の回転方向が反時計回りであり、HGA 500 はディスクの下面に対して右側からアクセスする。一方、図 19 において、スピンスタンド 1000 は、ディスク 550 の回転方向が時計回りであり、HGA 500 はディスクの下面に対して左側からアクセスする。例えば、アップ・ヘッドはスピンスタンド 100 で試験され、ダウン・ヘッドはスピンスタンド 1000 で試験される。スピンスタンド 100 およびスピンスタンド 1000 は、それぞれ必要な数だけ組み合わせることができる。最適に組み合わせられたスピンスタンド 100 およびスピンスタンド 1000 は、量産試験に最適である

う。

上記に説示したスピンスタンドおよびヘッド／ディスク試験装置は、例えば、以下のような変形が可能である。

インデックス信号発生器 I D X は、流体動圧軸受モータの回転軸に追加の装置または
5 機構を設ける事なく流体動圧軸受モータの回転軸の 1 回転（1 周期）を正確に知らせる
ものであれば良い。従って、インデックス信号発生器 I D X は、流体動圧軸受モータ 3
1 0 の内部で回転する永久磁石によって生じる磁束密度の変化をホール素子等で検出
し、磁束密度の変動からパルス信号を得て、そのパルス信号を分周する事によりインデ
ックス信号を生成するようにしても良い。また、インデックス信号は、パルス信号を分
10 周せずに、流体動圧軸受モータの回転軸が 1 回転する間に出現する複数個のパルスから
特定位置のパルスを抽出したものでも良い。

また、ディスク回転装置 3 0 0 の回転速度は、実際の HDD で採用される回転速度を
少なくとも 1 つ実現できれば良い。また、ディスク回転装置 3 0 0 の回転速度は、さら
に速くして 1 0 0 0 0 r p m や 1 5 0 0 0 r p m を実現できるようにしても良い。また、
15 それらの中間速度を実現できるようにしても良い。なお、回転速度を単一にすることが、
スピンスタンド 1 0 0 のコスト削減に最も貢献することはいうまでもない。スピンスタ
ンド 1 0 0 のコストが下がれば、ヘッド／ディスク試験装置 1 0 のコストも下がる。

さらに、ディスク回転装置 3 0 0 に用いるモータは、動圧軸受を用いたモータであれ
ば良いので、空気動圧軸受モータを使用する事も可能である。その場合、上記の文章は、
20 流体動圧軸受モータ 3 1 0 を空気動圧軸受モータに替えて読むことができる。

またさらに、離散位置決め装置 7 0 0 は、微細位置決め装置 6 0 0 の可動範囲を離散
位置に位置決めできれば良く、上述のように回転軸心が固定された回転位置決め手段に
限定されない。例えば、離散位置決め装置 7 0 0 は、回転軸心が固定されない回転位置
決め手段であっても良い。

25 以上詳細に説明したように、本発明のスピンスタンドは、磁気ディスクを回転させる
ディスク回転手段と、磁気ヘッドを着脱可能に支持し、前記磁気ヘッドを少なくとも前
記ディスクのトラック幅方向に移動させるヘッド移動手段とを備え、該ヘッド移動手段
は、微小可動範囲内で高精度の位置決めが可能な微細位置決め手段と、該微細位置決め
手段の微小可動範囲を所定の離散位置に設定する離散位置決め手段とを具備し、前記離
30 散位置近傍のみに前記磁気ヘッドを配置できるようにしたので、従来のスピンスタンド

に比べて小型軽量化する事ができた。

また、本発明のスピンスタンドは、磁気ヘッドの着脱時においても動圧軸受モータの回転が継続するようにしたので、従来のスピンスタンドに比べて、小型軽量化する事ができた。

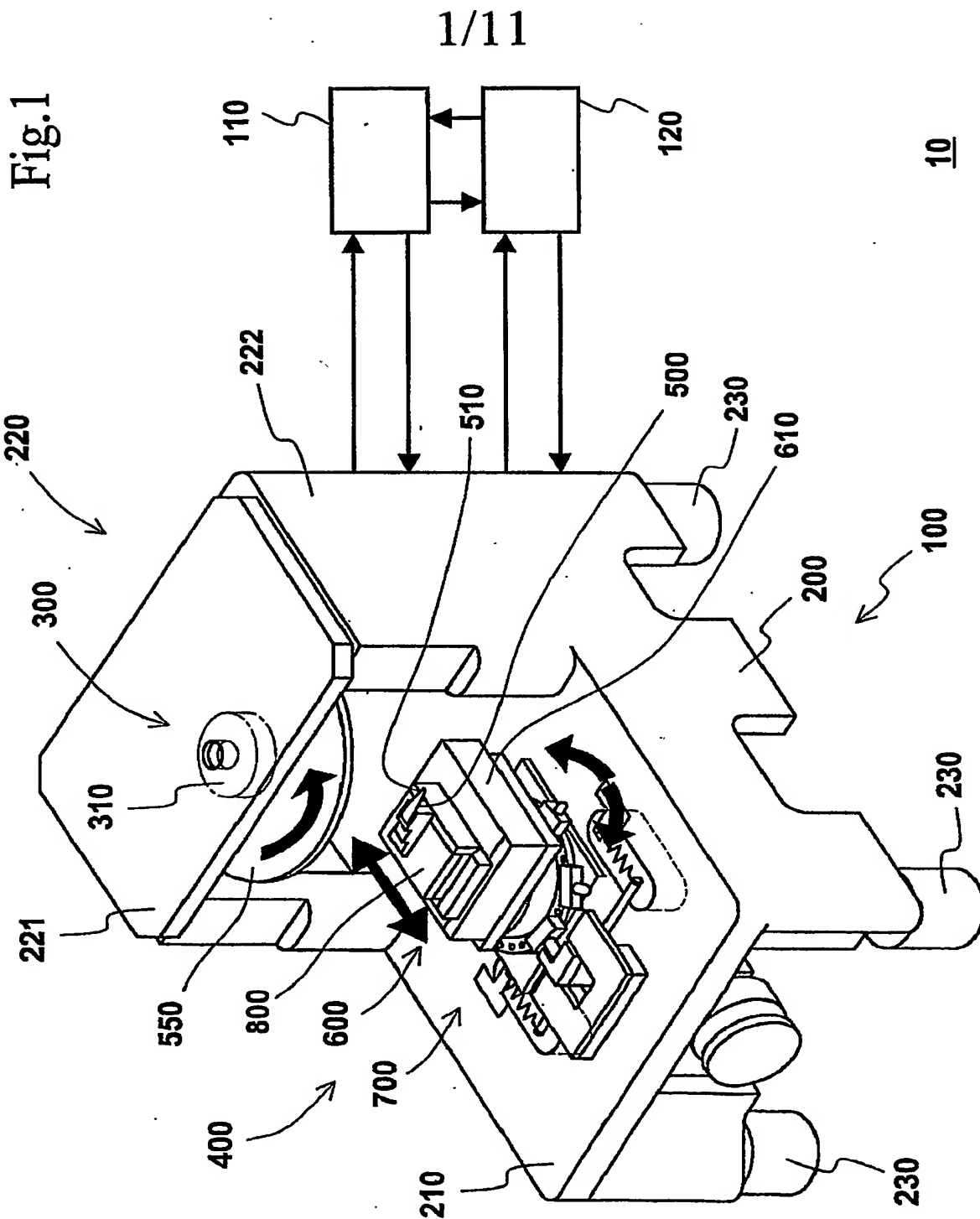
- 5 またさらに、本発明のスピンスタンドは、動圧軸受モータの回転により生じる逆起電力の変化または磁束密度の変化を検出しインデックス信号を生成する手段を備えるようにしたので、従来のスピンスタンドに比べて、小型軽量化する事ができた。

- さらに、本発明のスピンスタンドは、スピンスタンドの軽量化に伴い、スピンスタンドを支持する足に防振用ゲルを内装したバネを備えるようにしたので、スピンスタンド
10 の小型軽量化に伴い影響を受けやすくなる外部振動を、従来のスピンスタンドよりも小さくする事ができた。

結果として、本発明のスピンスタンドは、従来のスピンスタンドに比べて、その体積および重量が $1/40$ 以下になった。

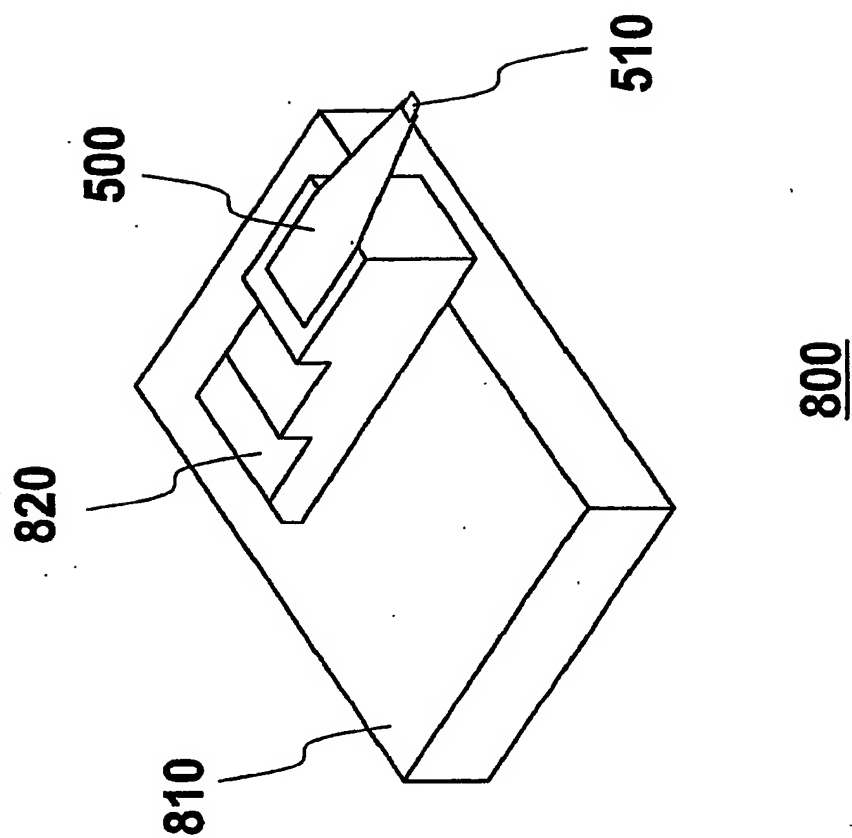
請求の範囲

1. 磁気ヘッドを着脱可能に支持するスピンスタンドであって、前記磁気ヘッドの着脱時においても回転を継続する動圧軸受モータを備えることを特徴とするスピンスタンド。
2. 動圧軸受モータと、該動圧軸受モータの回転により生じる逆起電力の変化または磁束密度の変化を検出しインデックス信号を生成する手段とを備えることを特徴とするスピンスタンド。
3. 動圧軸受モータを備えるスピンスタンドであって、前記動圧軸受モータの軸受には導電性流体が封入され、前記軸受が接地されることを特徴とするスピンスタンド。
4. 防振用ゲルを備えた弦巻バネによって支持されることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のスピンスタンド。
5. 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のスピンスタンドを備えることを特徴とするヘッド／ディスク試験装置。



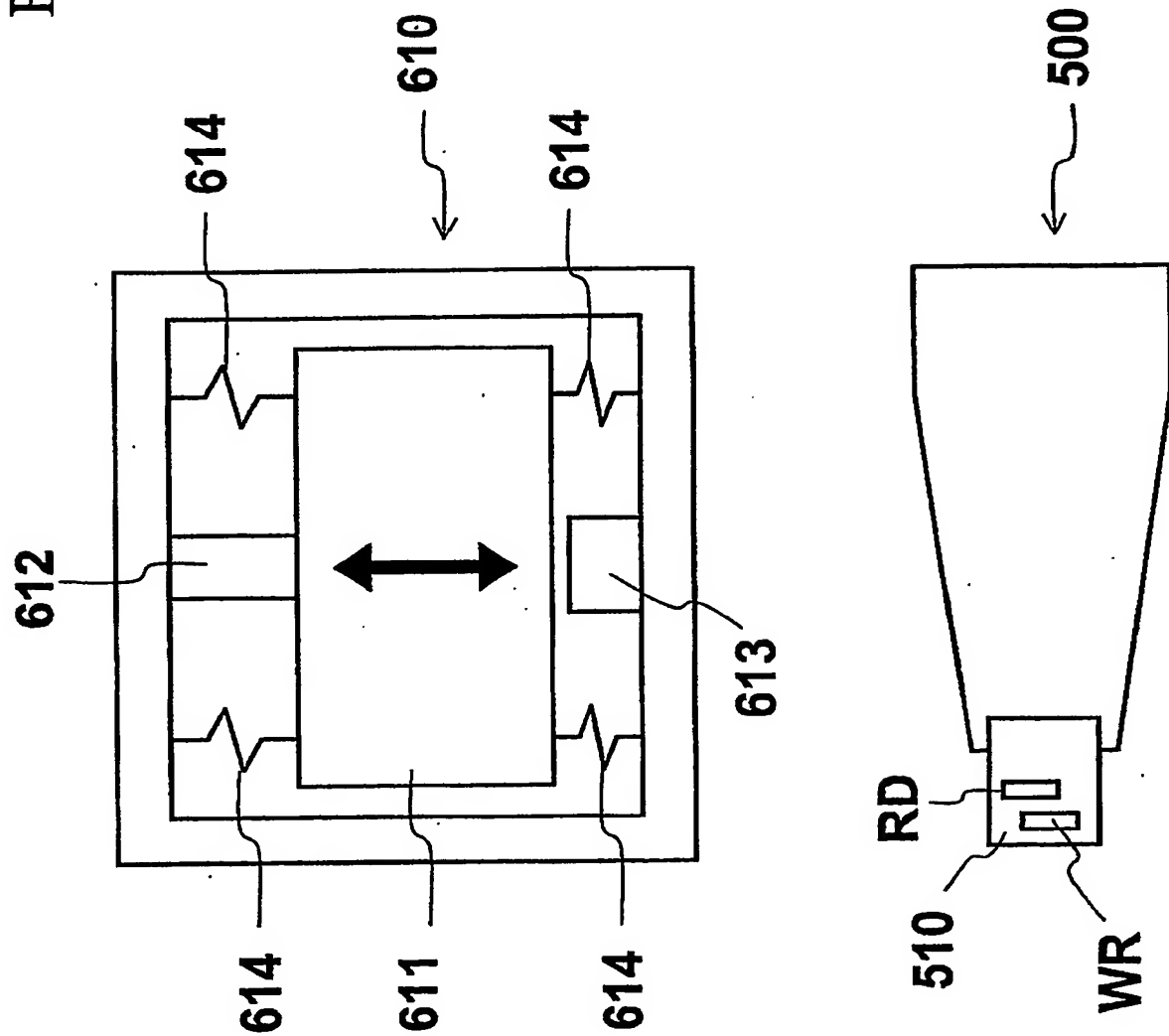
2/11

Fig.2



3/11

Fig.3



4/11

Fig.4

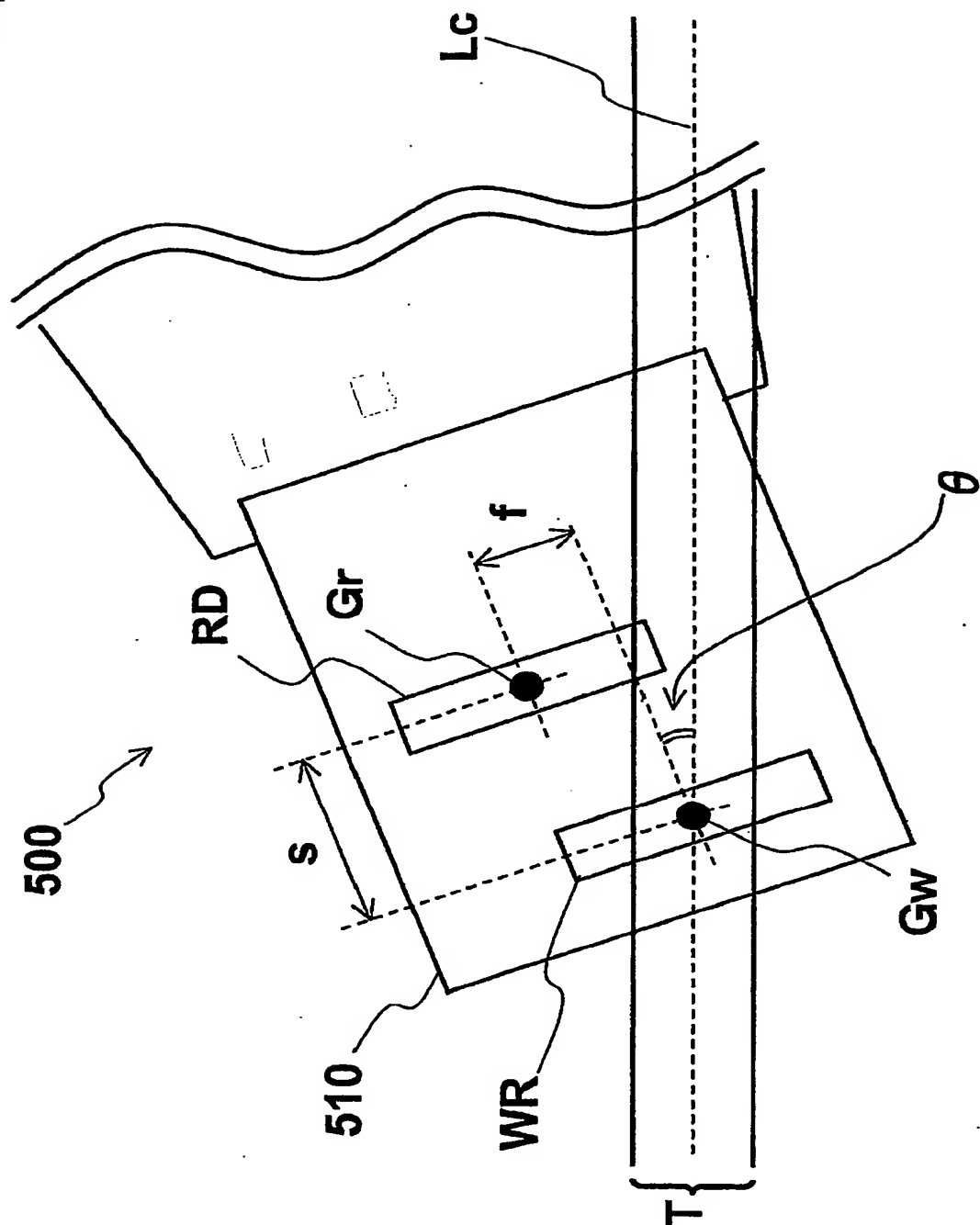
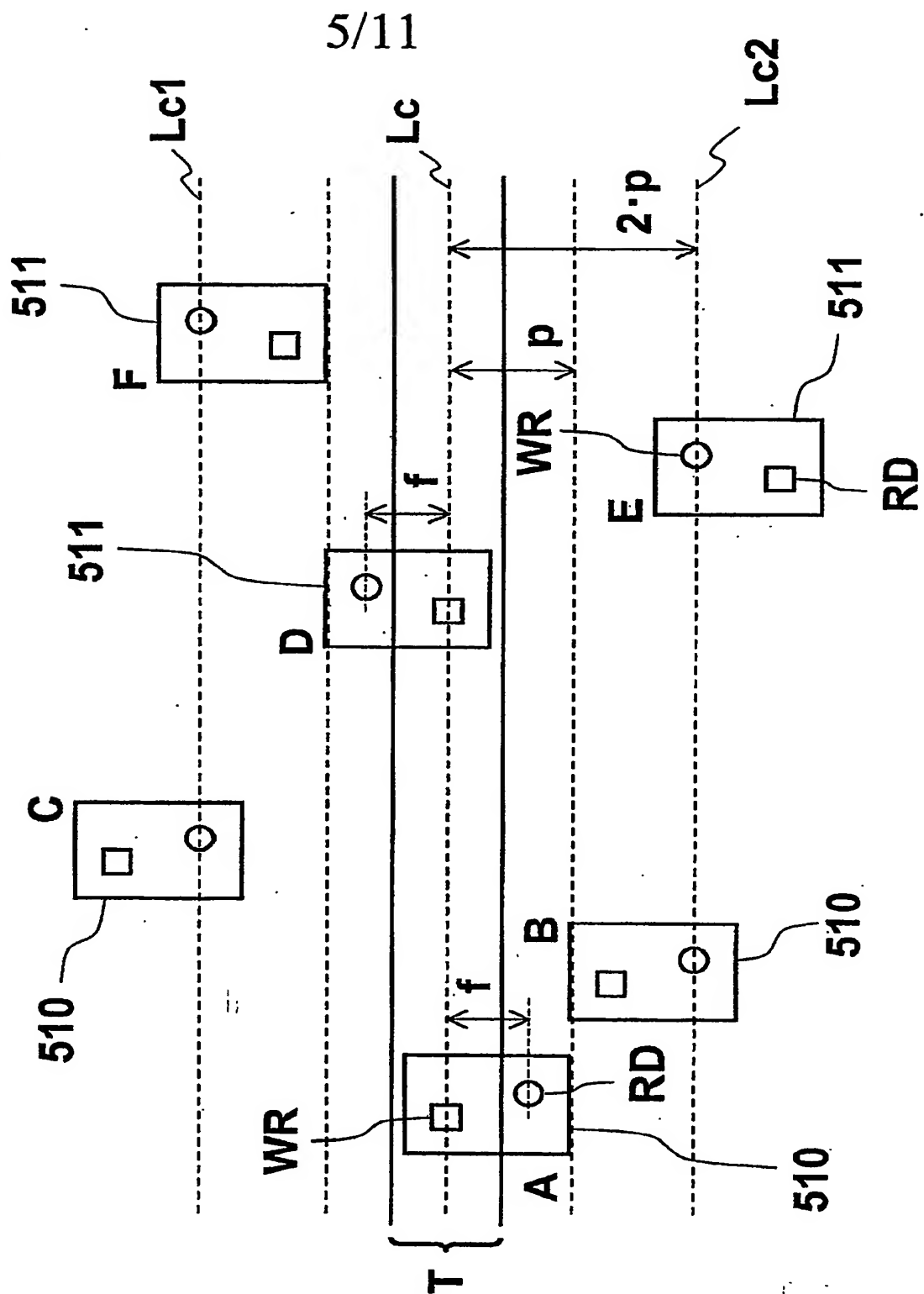


Fig.5



6/11

Fig.6

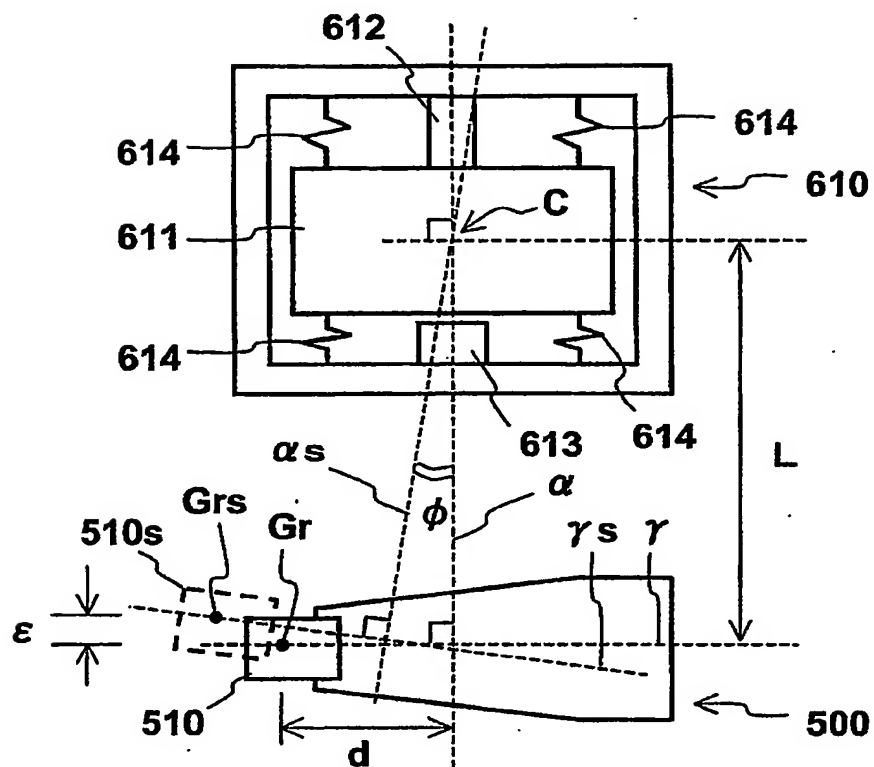


Fig.13

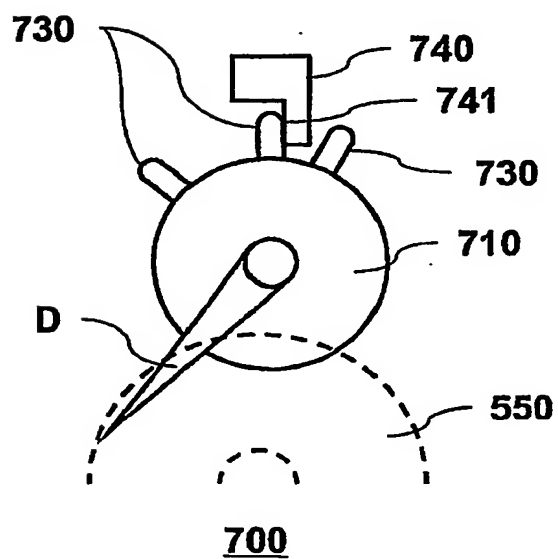
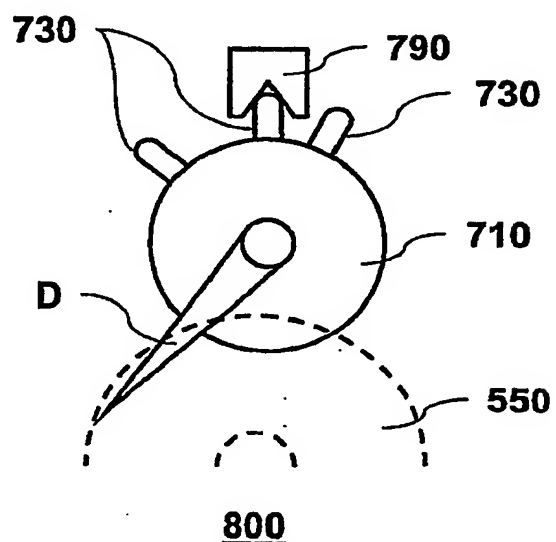
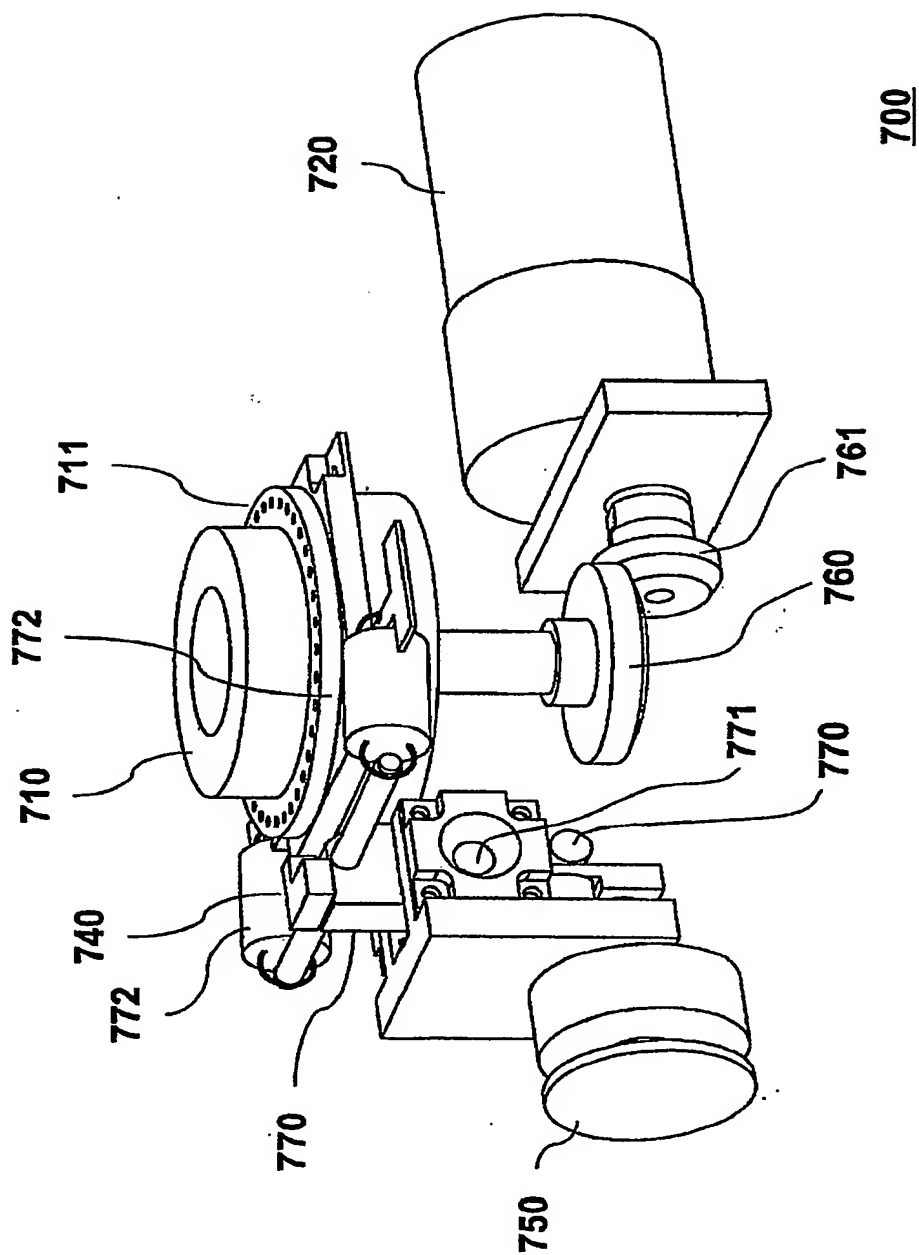


Fig.18



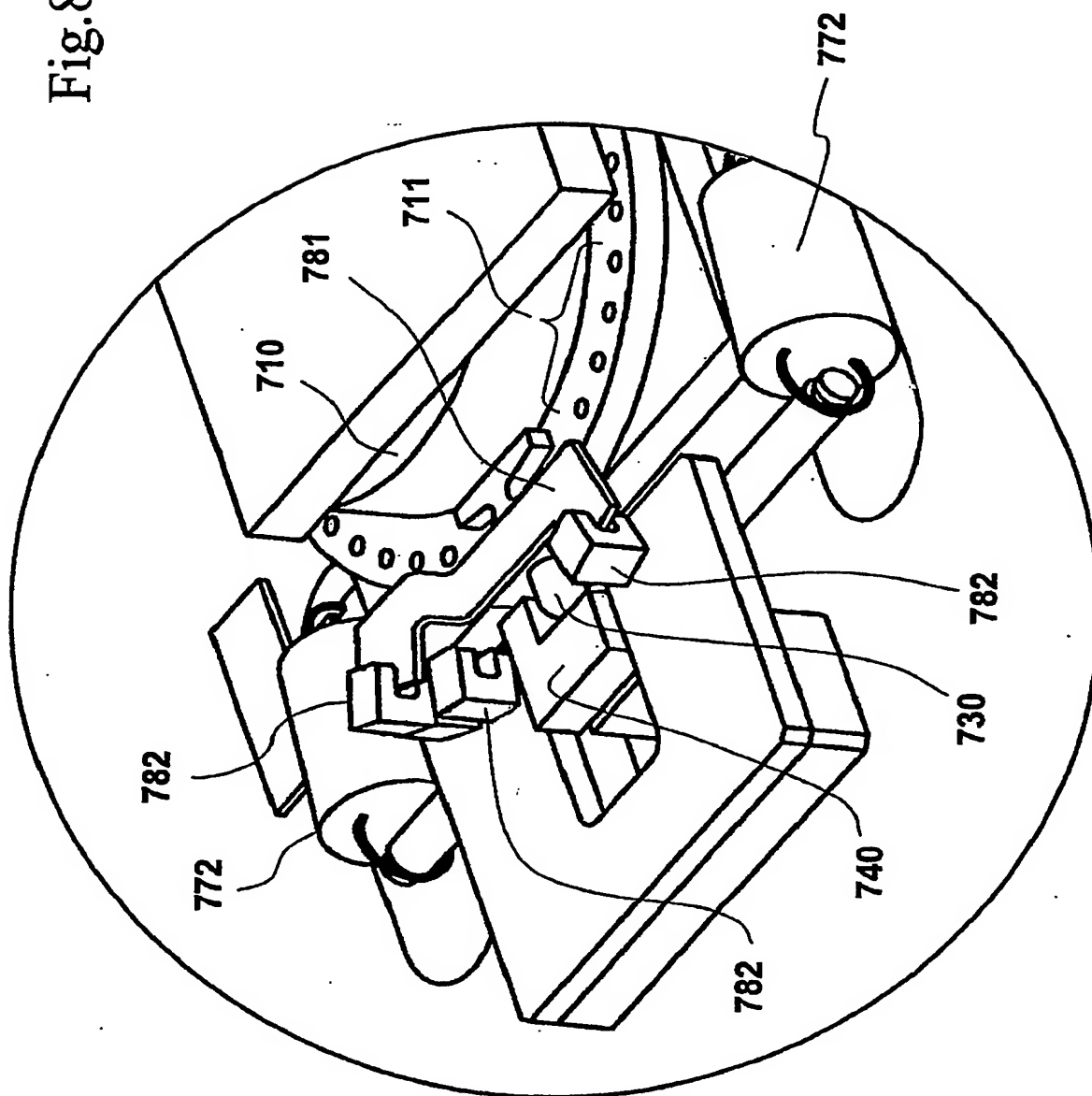
7/11

Fig.7



8/11

Fig.8



9/11

Fig.9

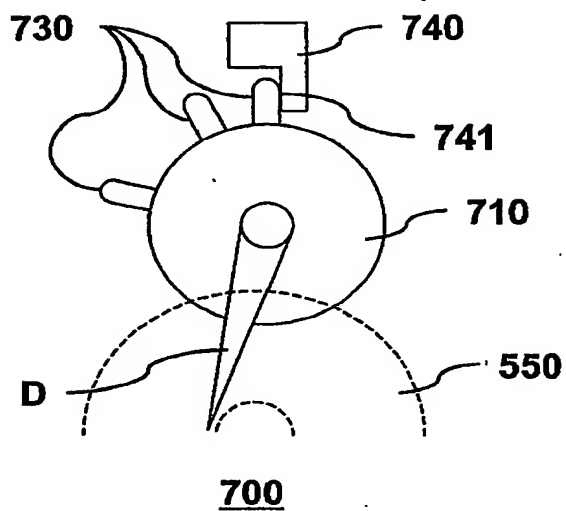


Fig.10

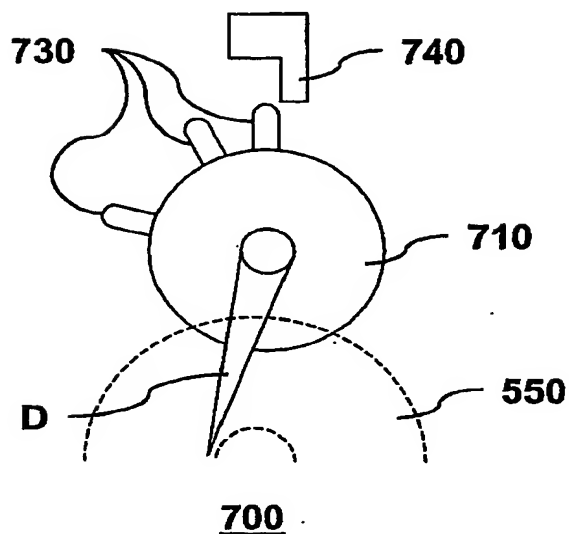


Fig.11

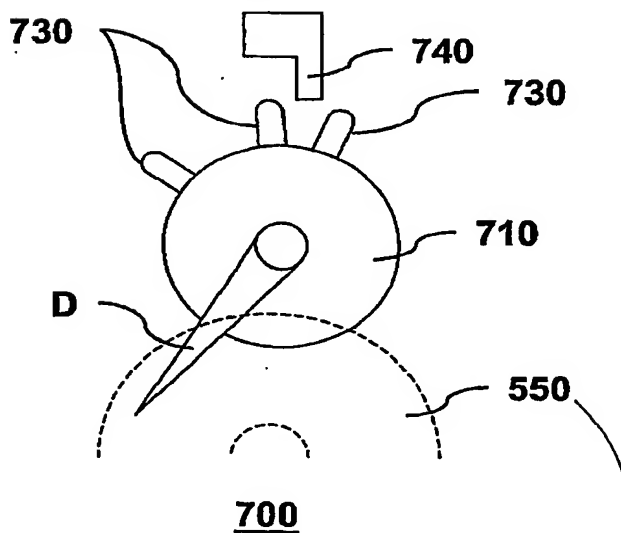
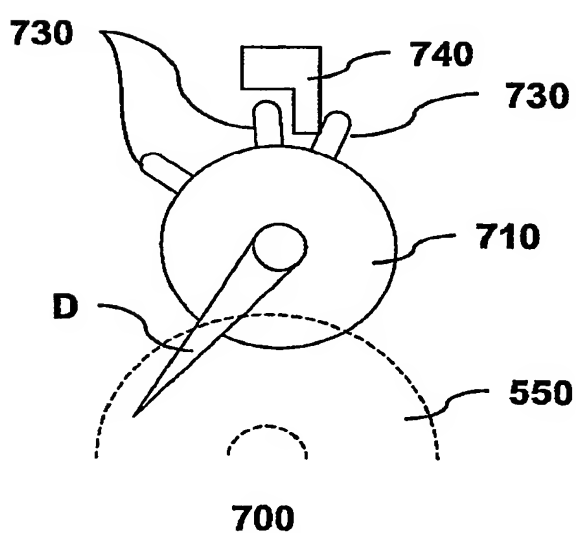


Fig.12



10/11

Fig.14

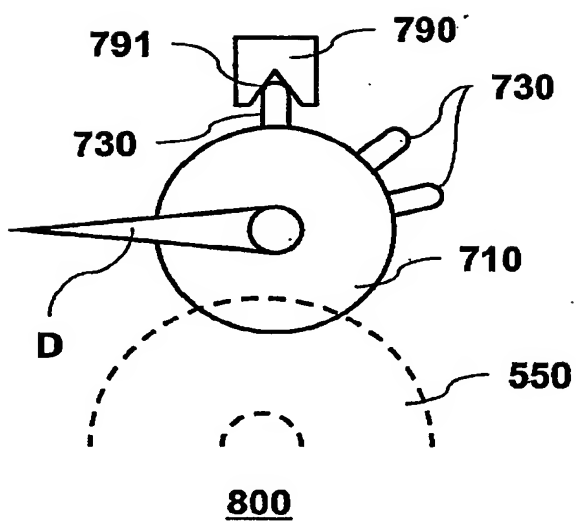


Fig.15

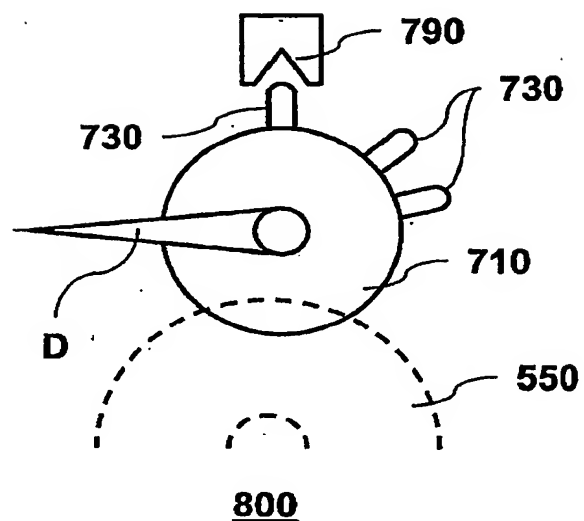


Fig.16

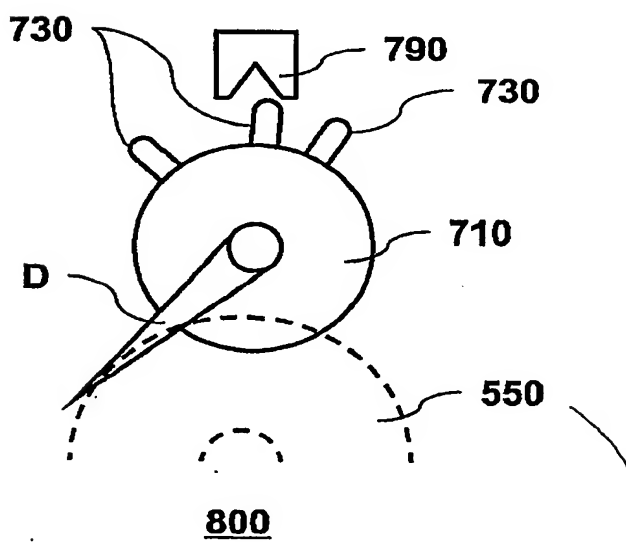
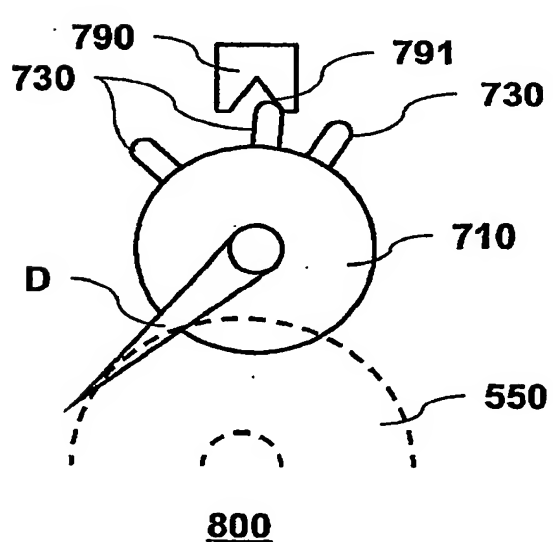
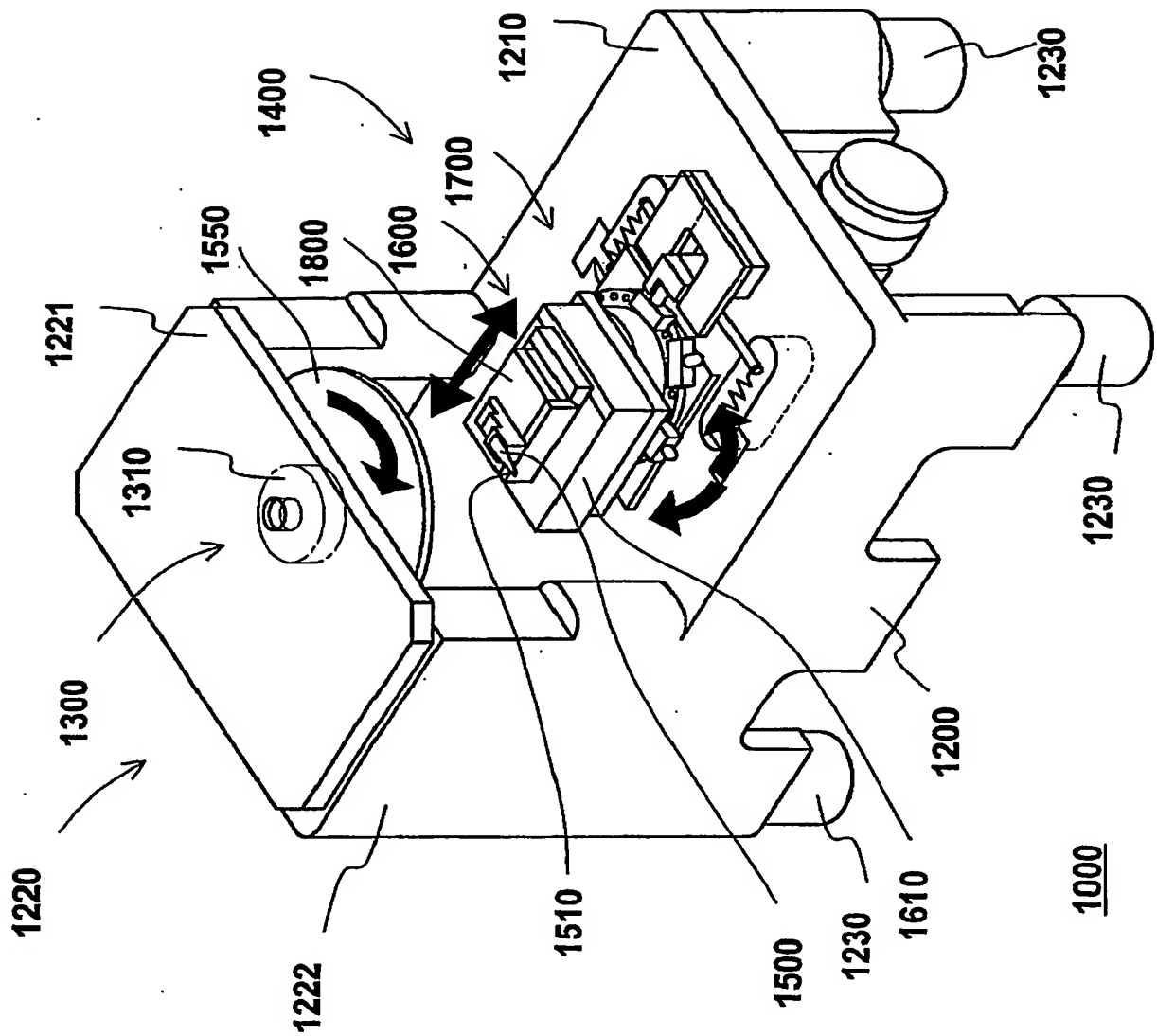


Fig.17



11/11

Fig.19



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11763

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G11B5/00, G11B5/455, G11B5/596, G11B5/84, G11B19/20,
G11B21/10, G11B21/21, H02K7/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G11B5/00, G11B5/455, G11B5/84

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2002
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2002	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-208133 A (Agilent Technologies Inc.), 26 July, 2002 (26.07.02), Par. Nos. [0021] to [0022] (Family: none)	1-5
Y	US 6105432 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 22 August, 2000 (22.08.00), Column 14, lines 45 to 61 & JP 2000-173032 A	1, 2, 5
Y	JP 3-28517 A (NSK Ltd.), 06 February, 1991 (06.02.91), Page 4, upper left column, lines 2 to 4 (Family: none)	3

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
13 January, 2004 (13.01.04)

Date of mailing of the international search report
27 January, 2004 (27.01.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11763

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 11-141605 A (NEC Corp.), 25 May, 1999 (25.05.99), Full text (Family: none)	4

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B5/00, G11B5/455, G11B5/596, G11B5/84,
G11B19/20, G11B21/10, G11B21/21, H02K7/08

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B5/00, G11B5/455, G11B5/84

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2002年
日本国実用新案登録公報 1996-2002年
日本国登録実用新案公報 1994-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2002-208133 A (アジレント・テクノロジー株式会社), 2002. 7. 26, 段落0021-0022 (ファミリーなし)	1-5
Y	US 6105432 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 2000. 8. 22, 第14カラム第45-61行 & JP 2000-173032 A	1, 2, 5

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

13. 01. 04

国際調査報告の発送日

27. 1. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

富澤 哲生

5D

9378

電話番号 03-3581-1101 内線 3550

[illegible]